(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[6]
H01L 21/3065

(11) 공개번호 특1997-0077310
(43) 공개일자 1997년12월12일

(21) 출원번호 특1996-0016221
(22) 출원일자 1996년05월15일

(71) 출원인 삼성전자 주식회사 김광호
경기도 수원시 팔달구 매탄동 416번지

(72) 발명자 현종선
경기도 수원시 팔달구 매탄동 주공4단지아파트 405동 107호
박광순
경기도 수원시 팔달구 매탄 2동 196-88번지
황상필
경기도 수원시 원천구 세류 4동 1093-23번지

심사청구 : 없음

(54) 건식식각설비의 웨이퍼 장착체의 구동장치

요약

건식식각 공정이 진행시 웨이퍼의 장착체를 회전시켜서 식각 균일도를 개선시킨 건식식각설비의 웨이퍼 장착체의 구동장치에 관한 것이다.

본 발명은, 챔버 내의 장착체의 각 면에 복수 개의 웨이퍼를 장착한 후 가스를 주입하여 식각공정을 수행하는 반도체 제조용 건식식각 장치에 있어서, 모터가 상기 장착체에 회전력을 전달하도록 구성되고, 상기 식각공정진행 중에 상기 모터에서 회전력이 제공되어 상기 장착체가 회전되도록 이루어진다.

따라서, 본 발명에 의하면 웨이퍼의 식각 균일도가 향상되어서 공정불량이 방지될 수 있고, 설비의 가동율을 향상시켜서 수율을 극대화시킬 수 있는 효과가 있다.

대표도

도2

명세서

[발명의 명칭]

건식식각설비의 웨이퍼 장착체의 구동장치

[도면의 간단한 설명]

제2도는 본 발명에 따른 건식식각설비의 웨이퍼 장착체의 구동장치의 실시예를 나타내는 측면도이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

챔버 내의 장착체의 각 면에 복수 개의 웨이퍼를 장착한 후 가스를 주입하여 식각공정을 수행하는 반도체 제조용 건식식각 장치에 있어서, 모터가 상기 장착체에 회전력을 전달하도록 구성되고, 상기 식각공정 진행중에 상기 모터에서 회전력이 제공되어 상기 장착체가 회전되도록 이루어짐을 특징으로 하는 상기 반도체 제조용 건식식각 장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면2

